

高度産業科学技術研究所

極端紫外線リソグラフィ研究開発センター

専任 staff :

教授、センター長： 渡邊 健夫

助教： 原田 哲男

秘書：

山本 真子

研究分野：

・ 極端紫外線リソグラフィ技術開発

EUV レジスト評価系およびレジスト材料の開発

EUV マスク用欠陥検査技術の開発

EUV 光源用大型ミラー評価

協力 staff :

特任教授： 木下 博雄

特任准教授： 工藤 宏人（関西大学生命化学工学准教授）

特任講師： 永田 豊（理化学研究所）

客員教授： 堀邊 英夫（大阪市立大学大学院工学研究科教授）

客員研究員： 富江 敏尚（産総研）、小池 雅人（日本原子力研究開発機構）、笹子 勝（Panasonic）、山田 素行（東京大学）

（敬称略順不同）